# X線光電子分光装置(XPS) 簡易マニュアル 解析編

#### 光電子分光分析研究室

連絡先 坂入正敏 内線7111 鈴木啓太 内線6882

## Spec Surf(Analysis)による解析



XPS装置用PC、解析用PC2台にXPSスペクト ルの解析ソフト「Spec Surf(Analysis)」がイン ストール済みです データ取得後、解析用PCにデータを移動さ

せて様々な解析を行いましょう。ユーザーの 方は解析用PCを無料でご利用頂けます ここでは解析ソフトの一般的な利用法に ついて紹介します

・主なデータ処理・解析機能

Processメニュー Smooth:

SpecSurf (Analysis)

スペクトルのスムージング Add or Subtract spectra:

スペクトル同士の加算減算 Charge Correction:

> 取得したスペクトルのリファ レンスピークのエネルギー値 を元にチャージシフトの補正

Satellite Removal, Spike Removal:

サテライトピーク、スパイクノ イズの消去

**Background Subtraction:** 

バックグラウンドの減算処理 Markers:

> Wide scanスペクトルから元 素同定を行う

Calculateメニュー Chemical Profile:

> Depth Profileデータに対す る波形分離

**Curve Fitting:** 

スペクトルの波形分離

Quantification:

相対定量計算

Peak Details:

ピーク強度・位置・半値幅の 表示

**Overlayer Thickness:** 

薄膜試料の測定結果に対して膜厚算出

#### Smooth



表示しているスペクトルの データセット全てに対して 平滑化処理を行います

#### Method

Simple: 単純移動平均法に よる平滑化処理 Savitzky-Golay: 多項式適

合法による平滑化処理

最小二乗法により多項式に近似出 来る点を求めて平滑値とする こちらの方がピーク形状を残しやす いと思います Parameters

平滑化演算に使用する 参照点数

> 多過ぎると効きが良くなる分、微 細な特徴を失います

#### OKを押すとデータに平滑化処理が行われます Previewのチェックを切り替えると処理前後のスペクトル に切り替わります



#### Add or Subtract spectra

Function	C Scaling				Proute
C Add	Gain 1	<u>.</u>	Sample: [2014]	0320_145431_W⊧▼	DIOWSE
Subtract	Offset: 0	÷	Hegion:	Wide	or
C Compare	Shift: 0	4	Level		

<u>•Function</u> Add: スペクトルの和 Subtract: スペクトルの差 Compare: スペクトル形状比較

#### Scaling

Gain: スペクトルに定数乗算し 強度変更

Offset: スペクトルに定数加算 Shift: スペクトルのエネル ギー軸移動 処理したいスペクトルを表 示した状態でAdd or subtract spectraを起動。Browseで比 較スペクトルを呼び出し、 Region, Levelを選択

スケーリングを整えて演算の種類を選び、OKを押すと 演算が実行される



#### **Charge Correction**

試料の帯電によってピーク位置が正規の値からずれている 場合に、リファレンスとなるピーク位置と正規の値との差を読ん で全てのRegion, Levelに対してエネルギー軸の補正を行います



- Reference	Reference Value	
C Carbon 1s	New 285.000	
C Oxygen 1s	Current 289.112	Cancel
C Other	Apply over	

例えば左の炭素1sのスペクト ルの289eV付近のピークは本来 C-C結合由来のものなので 285.0eVが正規の値です 参照とするハンドブックや測定条件等に

よります

Charge Correctionを呼び出した 際に表示されるラインをリファレ ンスピークの位置に合わせ、 Reference ValueのNewの項目に 正規の値を入力し、OKを押すと NewとCurrentの差だけ全ての Regionのエネルギー軸がずれて 値が補正されます

リファレンスピークは何でも構いません。一般的には測定試料に必ず付着するとされるコンタ ミネーションのC1sのピークをリファレンスと扱います。測定前までの行程はともかく、装置導入 後の真空引きでロータリーポンプのオイル由来の成分が試料に付着すると言われています。オ イルの成分はベンゼン環を形成しているのでC-C結合の値をコンタミのピークに対して当てると 良いと思います。とは言っても測定前までの処理過程や環境でどんな成分が付着しているかは 分かりませんし、C-C結合の値も参考とする文献やデータベースで結構値が違います (284.0~285.0eVぐらい)

他にリファレンスを試料に用意する方法として試料にAuなど化学状態があまり変化しないリファレンス元素を試料表面にコーティングしたり、紛体であれば紛体を混ぜ込んだり、メッシュを 重ねて測定するなど色々あると思います

単一のリファレンスのみでシフト量を考察するよりも複数のリファレンスで、測定している試料 の化学状態について、全体的に整合性の取れるシフト量を見積もる必要があります

導電性がない試料はもちろん、導電性がある試料でも数eV高エネルギー側にシフトしてる事が割とあります

## Satellite & Spike Removal



スパイクノイズがある場合、Spike Removalでノイズ位置にラインを当 てて平滑化参照点数を入力し、OK を押すと除去出来ます





#### **Background Subtraction**



Background Subtractionを 選択すると二つのラインカー ソルが表示されます。ピーク の終始点にラインカーソルを ドラッグし、Methodを選択、 Applyボタンで形成された バックグラウンドをスペクトル から除去します



All levelsにチェックをつけると depth profileのスペクトル全てに バックグランド除去を行います

定量計算を行っていく場合は この除去処理を事前に行ってお きます Method

Shirley: ピーク強度に比例した 曲線を形成

この方法が一番やりやすいです

Linear: 直線形でバックグラウ ンドを形成

Tougaard: Shirley法に電子の 散乱効果を含めた方法

 $\int_{E}^{\infty} \frac{B(E'-E)}{\{C+(E'-E)^2\}^2} J(E') dE'$ E: 光電子エネルギー J(E): 観測されるスペクトル B,C: パラメータ 優れたメソッドですが、パラメータの値 を決めるのが難しいです。B~2900、 C=1643が標準値で、計算範囲を広く取る

ようラインの位置を取った方がいいです

7

#### Markers



Wide scanの結果に対してピークの 同定をします

Markersを選ぶとスペクトル上にライン カーソルが現れます。ピークにドラッグし て当てるとSuggested Peaksに想定される 元素一覧が表示されます。Elementから 元素を選択してAddを押すと元素名がス タンプされます。元素によってはChemical Shiftの一覧も載っており、これもスタンプ 出来ます。最後にOKをクリックするとスタ ンプが残ります

Displayのチェックボックスで表示を各種変更出来ます





XPSハンドブックアイコンで標準試料 のスペクトルを見る事が出来るので参 考にして下さい

> スペクトルにはピークではないものが良く映り込 みます。間違って同定してしまわないように気をつ けて下さい。サテライトピーク、オージェピーク、ス ピン軌道相互作用による分裂など Mg-Kaだと730eV高いとこにO-Kα由来のスペクト ルが、230eV低いとこにAI-Kα由来のスペクトル (ゴーストピーク)が重なる事があります 近くに置いた別試料のピークが映る事もあります 8

## **Chemical Profile**



こつのラインカーソルの間が計算範囲です

主にDepth profileなどの多重ス ペクトルに対して、目的となる化 学状態のスタンダードスペクトル を用いて最小二乗法を用いた波 形分離を行います

> 遷移金属などは標準スペクトルを使った この波形分離の方が合いやすいです

Label	Leve	1	Region	Sample	Shift (eV)	Value 🕫 🔺	Open
Standard Spectrum [ Ti ]	0		Narrow	0	0.00	0.0	CulCasabar
20140320_162139_Acquiring_Depth_M	eKa 1	-	Ti 2p3/2 💌	0	0.00	0.0	Sta Spectrui
							Save
						-	Calculate
- Display	Fitting -			-			Profile
Spectra 🔽 Result	<b>⊽</b> F	it con	stant term		X <sup>+</sup> =		Show
✓ Besidual	VZ	'ero in	itial values				Close

この例ではTi酸化膜が表面に形成されたTi試料のデ プスプロファイル結果に対し、スタンダードスペクトルのTi(metal-Ti、バルク成分) と、デプスプロファイルの最初のスペクトル(酸化Ti、最初のスペクトル(酸化Ti、最 表面成分)を呼び出して波形分離を行っています。この結果として、酸化Tiと metal-Tiのプロファイルが 描かれます

青: metal-Ti

赤: 酸化Ti

Openで波形分離に用いるスペクトルを呼 び出します。Std Spectrumボタンでハンド ブックにあるスタンダードスペクトルのデー タも呼び出せます。Calculateボタンで計算 を開始します

結果はProfileボタン、Show/Hide ボタンでグラフや表で見れます

	Standard Spect	trum [ Ti ]	20140320_162139_Acqu	0140320_162139_Acquiring_Depth_MgKa			
	Value 00	Shift(eV)	Value %	Shift(eV)			
0	0.0	-4.00	100.0	0.71	Save As		
1	0.0	4.00	100.0	-0.00	Closes		
2	47.3	0.24	52.7	0.05	Liose		
3	68.7	0.17	31.3	0.03			
4	87.5	-0.01	12.5	-0.06			
5	90.2	-0.05	9.8	-0.08			
6	87.0	-0.06	13.0	-0.96			
7	87.6	-0.07	12.4	-1.06			
8	88.6	-0.09	11.4	-1.03			
Q	89.4	-0.11	10.6	-1.01			



Save Asで計算結果 を保存出来ます

#### **Curve Fitting**

# Curve Fittingでは得られたスペクトルに対し、最小二乗法で合成関数のフィッティングを行います

Curve Fitting 💦					×
Method Components Res	sults			Cing St.	
Method	Display —	Profiling	- Limits	1 1	Calculate
C Gauss-Lorentz	Sum Sum	Start 0	Start 292	<u>Upen</u>	Profile
C Sherwood	Residue	Finish D	Finish 276	Save	-
F Batio 07	Background				anow
	Markers	Leveis			Close
I∕ Background	Peaks	Update			
				and the second second	

#### Method

Gauss-Lorentz: ガウス関数と ローレンツ関数の混合関数 Sherwood: Gauss-Lorentz混合 関数の低エネルギー側にテーリ ングを付加した非対称関数

> Gauss-Lorents型は軽元素に合います Sherwood型は表面薄膜層の下地から出 てきているピークや遷移金属類に対して選 択すると良いと思います



合成関数の成分ピーク形 状をGauss-Lorentz型か Sherwood型か選択します

Ratioにチェックを付けると Gauss-Lorentzの混合比を ボックスに入力された値で固 定します

Backgroundにチェックを付 けると、Shirley型のバックグ ラウンド曲線を形成し、合成 関数に合成します

スペクトル上で左クリックす ると赤色のラインでフィットさ せる関数が現れます。分離し たい数だけ関数を呼び出し、 実測スペクトルに近づくようエ ネルギー値、半値幅、強度を ドラッグで修正します

#### **Curve Fitting**



Calculateボタンでフィッティング計算を行 います 赤ライン: フィッティング関数の各成分 青ライン: 実測スペクトル 黒ライン: 実測データと合成関数の残差 緑ライン: バックグラウンド曲線 ピンクライン:合成関数

Energy Intensity (cps) Width/2 Area Batig	Calculate
284,998 4407.1 0.539643 526.424 63.5765	Profile
286.606 1435.25 0.523562 166.33 20.0878	Chan
288.973 1460.99 0.418761 135.262 16.3357	
	ht Close

計算結果はResultsタブで確認出来ます 最小二乗法の残差平方和の値も表示さ れます。0に近づくと当てはまりの良い フィッティングと言えます

$$\chi^{2} = \frac{1}{N} \sum \frac{(I_{0} - I_{f})^{2}}{I_{f}}$$

N: フィッティング点数 I<sub>0</sub>: 実測スペクトル強度 I<sub>f</sub>: フィッティング計算結果の強度 Saveボタンで左表の データと各フィッティン グ関数成分のグラフ データを保存出来ま す

デプスプロファイル など多重スペクトルに Curve Fittingを行うと、 各レベルの波形分離 計算のプロファイルを 得られます

#### **Curve Fitting**



保存形式は「.ssc」です

Methodタブの方でSaveする と成分関数の設定値を保存 する事が出来、また呼び出す 事や、他の解析 (Quantificationなど)にこの波 形分離計算結果を利用する 事が出来ます

Energy	Intensity	Width/2	OTR
284,998	440.71	0.539643	0.4000
286.606	140 505	9.523562	0.4000
288.973	Delete All	.418761	0.4000
	Move up Move down		
	Fix to previous		

Componentsタブではフィッテング関数 の各成分の各パラメータが表示されま す。値を直接入力出来ます セル上で右クリックする事で関数の消 去(Delete)、各パラメータの固定(Fix)、各 パラメータの上下の行との相対値の固 定(Fix to previous, next)が可能です

波形分離による化学状態同定のポイント

- まず分析したい元素のスペクトルを出来るだけS/N良く、分解能良く、正確に取得する。ダメ なスペクトルを前に波形分離を試行錯誤してもまともな答えは出ません。試料の前処理やホ ルダーへの固定法も条件を整える事が重要です
- 他の分析結果、実験条件、標準試料からの類推で、ある程度現れるべき化学状態について 絞れている必要があります。無策な波形分離の計算結果からのみでは化学状態は同定出 来ません
- フィッティング計算を行う際、出来るだけフィッティング関数成分のパラメータ(変数)を固定出 来ている方が良いです。そのためには上記の通り、ある程度化学状態について予測がつい ていなければなりません。予測がついていればハンドブックや参照してる論文の値などを持 ち込んでパラメータ(特にエネルギー値)をFixして計算させましょう。相対値の固定(Fix to previous, next)はチャージシフトの補正の誤差や測定環境の違いにも対応出来るので、各化 学状態のピーク位置の相対値固定をお勧めします
- スペクトル形状から視認出来るピークの数だけフィッティング関数の成分を用意しましょう。
   視認出来ていないのに関数成分を無暗に増やすと訳が分からなくなります。フィッティング結果の残差成分を見て、ノイズレベルを超えたピーク形状が見られたら関数成分を追加した方が良いです
- X二乗の値を出来るだけ小さくなるようにしましょう。ただ関数成分を増やすと嫌でも小さくなりますので注意です

## Quantification

egions Settings				
-Intensity	Profile / Table		Curve Fit Result	ОК
· Peak Height	Data	│ ┌Y Axis Style ────	I I I Peaks	キャンセル
C Peak-Peak	© Quantify (Atomic%)	G Absolute	F Background	Profile
	C Intensity (cps)	C Normalised	C Threshold	

Narrow scan等のスペクトルに対してQuantificationを選択す ると相対感度因子法による定量計算が行えます 予めバックグラウンドは除去して下さい 始めにSettingsタブでIntensityの種類を選びます Peak Height(計算範囲内の最大強度をピーク強度とする) Peak Area(計算範囲内のスペクトル強度面積をピーク強度とする) 計算範囲はスペクトル上の緑と赤のラインカーソルの間です

ions Settin	es							
Element	State	Label	Sensitivity	Intensity (cps)	Atomic %		OurveEit Eile	 ОК
C C	• <u>305/2</u> • 1s	 Ag 3d5/2 C 1s	42.2839 4.0790	23370.00 1506.67	X	59.94 40.06		キャンセル
								Profile
								Table

Regionsタブでは測定したElement, Stateが自動で選ばれ、 それぞれのSensitivityが呼び出されており、定量結果も出て います。Atomic%のチェックを外すと定量計算から外れます

anti	lication Profile		ie Antonio de Center da ministra frenti	and a subscription of the second second		under internet and the distance		and the second state
	Level	Level	C 1s #1	C 1s #2	C 1s #3	O 1s #1	0 1s #2	Save As
1	0	(	45.469403	14.366610	11.683131	15.197822	13.283034	

# Tableをクリックすると定量のプロファイルが現れます。Save Asで結果の保存が出来ます

## Quantification

#### × Quantification Regions | Settings | OK Label Intensity (cps) Atomic % CurveFit File State Sensitivity Element 10746.97 🗆 4.2586 キーシャー • 1s C 1s C 45.47 PET波形分離.ssc 4.2586 5264.25 🗉 C • 1s 💌 C 1s #1 14.37 PET波形分離.ssc Profile 4.2586 C -1s • C 1s #2 1663.30 🖾 11.68 PET)废形分離.ssc 1s • C 1s #3 1352.62 🛛 C -4.2586 Table • 01s 11.9144 16986.89 🗆 -0 15 15.20 PET波形分離O.ssc 0 -1s • 01s #1 11.9144 4922.73 🗵 13.28 PET波形分離O.ssc 1s • 0 1s #2 11.9144 4302.51 🖾 + 0

201-202-203-203-204-

Regionsタブで、Curve Fittingの結果 を呼び出す事が出来、各関数成分ご との定量値を計算する事が出来ます



Depth Profileに 対してはProfileボ タンで左画のよう な定量結果のグラ フを得る事が出来 ます

## Peak Details Overlayer Thickness



ニつのラインマーカーで 選択した範囲のピークに ついて情報を算出します 情報をSave Asで保存出 来ます Backgroundにチェックす

るとShirley型のバックグラ ウンドを除去します

15

verlayer Thic	kness Calculatio	n			
	Substrate	Overlayer			
Element	Cu	• Au		Tilting Angle (deg.)	0
Region	2p3/2	• 4f7/2	<b>-</b> 1		
Energy	932.0755	85.5346		- Besult-	
Intensity	880.029	792.114			
Density	8.92	19.3		I hickness (nm)	JU.646
Cross-section	16.73	9.58			
Mean free path	1.05009	1.9978			
Atomic mass	63.546	196.967			

選択された薄膜と下地層からの光電子ピークのIntensityから薄膜の膜厚を算出します

※対象となるピークが同一領域に含まれている必要が あります。Wide scanスペクトルでやるか、薄膜成分、下 地成分両方抑えるようNarrow scanを実行して下さい。 またバックグラウンドは除去しておきます

Element・Regionを薄膜と下地それぞれ設定します。Density やCross-sectionなどのパラメータが用意されます。スペクトル 上のラインカーソルを薄膜成分と下地成分の各ピークに当て て、ホルダーを傾けている場合はTiltを入力します Resultに計算結果が出ます





CompareアイコンでCompare機能を呼び 出せます。複数のスペクトルを重ねて表示 したり、波形分離結果を載せる事が出来ま す。スペクトルの比較に便利です





Imageデータを開くと画像の編集が行えます
各種アイコンでは
・コントラスト・ブライトネスの調整
・マッピングの重ね表示
・像のリサイズ
・強度の定義の変更
Processメニューでは
・Average処理(平滑化)
・Median Filter処理(ノイズ除去)
・Sharpen処理(エッジ強調)
・像の回転、リサイズ

# おまけ

- 遷移金属類の化学状態分析では一緒に出てくるオージェピークを取っておくと役立ちます。光電子のケミカルシフトはないけどオージェピークが結構ずれてて違いがあったりします。もしくは初めからオージェ分光装置を使って下さい
- 化学状態分析ではcurve fittingの手法の他、chemical profileでの主成分分析という手やオージェ パラメータ測定など色々あります。軽元素類はcurve fittingでgauss-lorentz型を使う。遷移金属な どピーク形状が歪なものはSherwood型を使うor主成分分析を行うorオージェパラメータを見ます。 主成分分析は化学状態の成分の可能性があるものを用意して各々スペクトルを取得し、そのス ペクトルを利用して波形分離をするというものです。全て測定サンプルと同一条件でスペクトルを 取る必要があります。オージェパラメータは光電子ピークとオージェピークの相対値を読むもの です
- ピークの強度が足りないという場合、①サンプル量を増やす(紛体など) ②ステージZ軸をしっかり調整
   ③測定エネルギー範囲をギリギリまで絞って時間を稼ぐ
   ④必要十分なエネルギー分解能までパスエネルギーを上げるandステップ間隔を広げる
   ⑤X線強度を上げる(max 12kV25mA)
   ⑥高傾度に傾ける(最大80度、注意)などを試して下さい。また試料前処理としてコンタミネーションがたくさん載ってしまう事のないような手続きを取って下さい。載ってしまったのならAr+イオンガンでエッチングをしましょう(ただし、エッチングによるサンプル影響を考える)
- 試料の準備に気をかけて下さい。サンプル表面を少しでも触ったりいじったりしたらもうコンタミネーションしか成分として出てきません。長い事空気中に置きっぱなしにしてるサンプルもコンタミまみれです。サンプルの保管方法も大事です。表面に何かが触れてしまうような事がないようにしましょう。カーボンテープなど揮発物を周囲に置きすぎるのも注意(ちょっとならいいけど)
- 試料の履歴を良く把握しておきましょう。履歴が不明瞭なものを測っても出てきたものの正体が つかめません
- チャージが起きやすい試料で、ピーク半値幅がブロード気味なサンプルの定量評価では強度を ピーク面積にしましょう。チャージが原因でピークがブロードになってしまってもピーク面積に変化 はないので定量評価に問題はありません